

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】令和3年4月30日(2021.4.30)

【公開番号】特開2019-180908(P2019-180908A)

【公開日】令和1年10月24日(2019.10.24)

【年通号数】公開・登録公報2019-043

【出願番号】特願2018-76463(P2018-76463)

【国際特許分類】

A 6 1 N 5/10 (2006.01)

【F I】

A 6 1 N	5/10	P
A 6 1 N	5/10	H

【手続補正書】

【提出日】令和3年3月15日(2021.3.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

非特許文献1では、与えられた照射条件における $f_d(z_d, z_n)$ および $f_n(z_n, D)$ を計算するための計算モデルを開発され、[数3]および[数4]を数値的に解いた。複数イベント照射の $f_d(z_d, z_n)$ および $f_n(z_n, D)$ の計算は、それぞれの照射条件についてモンテカルロ法による巨視的ビーム輸送シミュレーションを必要とし、さらに、 $z_d$ および $z_n$ の単一イベント確率密度 $f_{d,1}(z_n)$ および $f_{n,1}(z_n)$ の積分を必要とするので、計算時間が膨大であった。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0061

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0061】

加速器4は荷電粒子ビーム3の強度を調整する。

照射装置6は、荷電粒子ビーム3をビーム進行方向(Z方向)に垂直な平面を形成するX-Y方向に偏向させるスキャニングマグネット(図示省略)と、荷電粒子ビーム3の位置を監視する線量モニタ(図示省略)と、Z方向の荷電粒子ビーム3の停止位置を調整するレンジシフタ(図示省略)とを備え、ターゲット部8に対しスキャン軌道に沿って荷電粒子ビーム3をスキャンする。